

# 臺大材料系 FEI FIB 自行操作鑑定辦法

## 壹、本儀器自行操作資格分為二級:

一級操作者:能夠完整安全操作儀器並切出可使用的 TEM 試片，可於任何時間自行操作，唯夜間及假日必須事先向技術員提出申請，經指導教授同意後方可使用儀器。

二級操作者:了解電子束的基本操作、緊急應變措施、並可正確操作 Aztec 軟體 EDS 功能，只能在上班時間自行操作儀器。

## 貳、參加鑑定資格

一、具有臺大工學院學生身分。

二、因需要出色的對焦能力，故需備有 SEM 操作經驗。

三、接受陪同操作滿 12 小時。(以計費登記簿為準)。

## 參、鑑定時間由受鑑定者與技術員約定。

## 肆、考試:

一、80 分以上及格。

二、一級操作者:考試包含電子束和離子束的操作和 TEM 試片製作兩部分，為時 3 個小時。取得一級自行操作執照資格後 6 個月內，無使用儀器者，資格取消，需重新鑑定才能夠再取得資格。二級操作者:考試內容為電子束基礎操作、緊急應變措施和 Aztec 軟體 EDS 全部功能包含正確操作 Feature，考試時間 3 小時。

## 三、評分標準:

1.儀器操作:90%，重大錯誤(有損儀器可能或是製備試片失敗)每次扣 30 分。較小錯誤(無害儀器可能)每次扣 5~10 分。

2.純熟度:10%